

真空薄膜製程及其在奈米科技上之應用

劉達人

Da-Ren Liu

國家實驗研究院儀器科技研究中心

新竹市科學園區研發六路 20 號

*Instrument Technology Research Center, National Applied Research Laboratories,
Hsinchu, Taiwan*

摘要

真空薄膜製程在現今許多產業，如半導體、太陽能、面板及光電等產業上，皆扮演著關鍵且極為重要的角色，而在物理、化學、奈米技術、材料與電子等相關研究領域上，更是不可或缺的研究工具之一。本報告將針對各式真空薄膜製程之特性及應用範圍，包含物理氣相沈積製程(PVD)及化學氣相沈積製程(CVD)等作一說明。並對儀科中心近年來在真空薄膜製程技術開發的研究成果及其在奈米技術與材料上之相關應用作一介紹。